

晶圓Chip 外觀檢查機

相機畫素
5M

檢測精度
2.3um

最小檢出
10×10um



更多產品

印刷電路板檢測系列、平面顯示器檢測系列、半導體檢測系列
隱形眼鏡檢測系列、鋰電池檢測系列

翔緯光電股份有限公司

TEL : 02-2668-7335 FAX : 02-2668-4322

E-MAIL : service@wisforce.com.tw

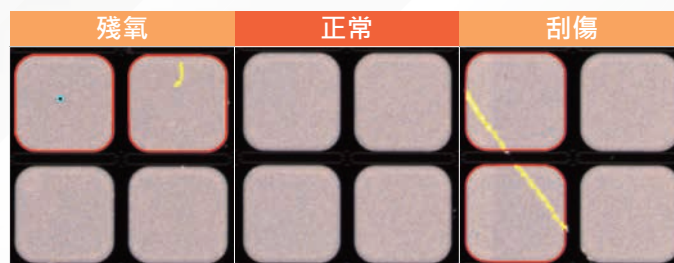
ADD : 238 新北市樹林區佳園路二段59-6號



www.shyawei.com.tw



晶圓Chip 外觀檢查機



伺服馬達軸搭配光學尺，其往復定位精度於 $\pm 3\mu\text{m}$ ，提供光學模組精準定位。

Wafer治具使用多孔真空吸附，可將Wafer平整吸附，提升定位精度需求。

檢測樣品	樣品樣式	晶圓
	尺寸範圍	4"、5"、6"wafer
	精度需求	最小檢出尺寸 $10\times 10\mu\text{m}$
	檢測項目	外觀缺陷檢查(外物沾黏、髒污、龜裂、刮傷...等等外觀缺陷。)
光學規格	檢測方式	Area scan
	相機畫素	5M
	檢測精度	$2.3\mu\text{m}$
設備規格	設備尺寸	1700(長) \times 900(寬) \times 1950(高)mm (長度不含檢測軟體電腦箱體)
	進料方式	人工進料
	出料方式	人工出料
	Tact time	200 sec/sheet (6") (視chip分布大小數量訂定)
	操作模式	Semi Auto
	控制方式	PC
	電源規格	單相 / AC 220V / 60Hz
	氣壓規格	正壓 : $0.5\sim 0.6\text{MPa}$

